

保全対応可能リスト 2016.8.26 updated

【評価基準】

- 1 : 装置各部の名称や配置を理解し、指導を受けながら補助作業を行う事が出来る
- 2 : 主担当として調整・確認作業ができ、発生事象を見て不具合箇所を確認する事が出来る
- 3 : ユニットの働き（目的）が理解でき、各種データ（信号レベル・信号波形など）を基に、ユニット単位での不良箇所判定が出来る
- 4 : トラブル時、系統立て不具合箇所の調査・復旧、部品単位での不具合箇所調査・復旧が出来る

CVD

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	定期点検	機械駆動系	備考
AMAT	P-5000 TEOS CVD	①	6 inch	3年	1	3	2	1	1	1	
	P-5000 SA CVD	①	6 inch	3年	1	3	2	1	1	1	
	CENTURA SA-CVD	③	5 inch	12年	4	4	4	4	4	4	
	CENTURA-W	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
	CENTURA	⑳	5 inch	1.5年	-	-	-	-	3	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応
	CENTURA	㉔	5 inch	1.5年	-	-	-	-	3	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応
	CENTURA EPI HT	③	5 inch	12年	4	4	4	4	4	4	
	CENTURA POLY HT	③	5 inch	12年	4	4	4	4	4	4	
	Producer SE/GT	④	12 inch	2年	1	1	-	-	2	-	日常点検業務
Ultima HDP	④	12 inch	2か月	-	1	-	-	2	-	日常点検業務	
日本ASM	E-10	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
	E-10	③	5 inch	12年	3	4	3	3	3	4	
	E-10	⑤	5 inch	2年	2	2	1	1	1	1	チャンバー洗浄業務全般
	E-10	⑤	8 inch	2年	2	2	1	1	1	1	チャンバー洗浄業務全般
WATKINS JOHNSON	TEOS999	①	6 inch	4年	4	-	4	4	4	4	
	TEOS999	③	5 inch	12年	4	-	4	4	4	4	
	TEOS999	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
	TEOS999	⑤	5 inch	2年	1	-	1	1	1	1	
	WJ-999	⑩	6 inch	6ヶ月	3	2	-	1	1	-	常圧CVD装置
	WJ-999	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
WJ-999	㉒	6 inch	20年	3	3	3	3	-	3		

CVD

メーカー	型式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	定期点検	機械駆動系	備考
SCREENヒュンダクター (大日本スクリーン)	LA-820	①	6 inch	12年	4	4	4	4	4	4	
	LA-820	②①	6 inch	20年	4	4	4	4	-	4	
日本生産技術 (JPEL)	VDS-5600	②⑤	5 inch	1.5年	-	-	-	-	3	-	
	VDS-5600	②④	5 inch	1.5年	-	-	-	-	3	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応
アプトシステムズ	VMP-100PRO	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
天谷製作所	AMAX121	③	5 inch	12年	4	-	4	4	4	4	
東横化学	TNV-1,TNV-2	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
	TN-6	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
	VC-7000	⑩	6 inch	5ヶ月	2	1	-	2	1	-	縦型CVD装置
日立国際電気	DJ-802V	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	-	1	
	DD系12インチ	⑩	12 inch	1年	3	3	-	2	2	-	
	DJ系12インチ	⑩	12 inch	2年	3	3	-	3	2	-	縦型CVD装置
MESアフティ	M-PAD	②⑥	12 inch	1年	-	4	4	3	2	3	液晶ALD装置立ち上げ
NOVELLUS	Concept One	②③	ALL inch	12年	4	4	4	4	4	4	PECVD
	C2-SEQUEL	②③	ALL inch	12年	4	4	4	4	4	4	PECVD
	C2-SPEED	②③	ALL inch	12年	4	4	4	4	4	4	PECVD
	C3-SPEED	②③	ALL inch	12年	4	4	4	4	4	4	PECVD
	C3-VECTOR	②③	ALL inch	3年	3	3	3	2	2	3	PECVD

METAL

メーカー	型式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	電気系	機械駆動系	備考
キャノンアネルバ	I-1060 Co	⑥	8 inch	5年	-	-	-	-	-	-	シールド交換
	I-1060 Ti	⑥	8 inch	5年	-	-	-	-	-	-	シールド交換
	I-1060 Tin	⑥	8 inch	5年	-	-	-	-	-	-	シールド交換
	ILC-1051/1060	②①	6 inch	20年	4	4	4	4	-	4	
	ILC-1060	⑫	6 inch	2年	2	3	2	-	-	-	手順書参考での作業
	ILC-1051	⑫	6 inch	20年	2	3	3	3	-	3	
	ILD-4015	⑫	6 inch	20年	2	3	3	3	-	3	
	ILD-4017	⑫	6 inch	20年	2	3	3	3	-	3	
	ILD-4033	⑫	6 inch	20年	2	3	3	3	-	3	
SPC-530H	⑫④	5 inch	1.5年	-	3	-	-	-	-	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応

METAL

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	電気系	機械駆動系	備考	
AMAT	CENTURA Al PVD	①	6 inch	12年	4	4	4	4	4	4		
	CENTURA Al PVD	⑫	6 inch	20年	4	4	4	4	-	4		
	CENTURA Ti PVD	①	6 inch	12年	4	4	4	4	4	4		
	CENTURA Ti PVD	⑫	6 inch	20年	4	4	4	4	-	4		
	CENTURA TiN PVD	①	6 inch	12年	4	4	4	4	4	4		
	CENTURA TiN PVD	⑫	6 inch	20年	4	4	4	4	-	4		
	ENDURA Al PVD	①	6 inch	12年	4	4	4	4	4	4		
	ENDURA Al PVD	⑥	8 inch	5年	-	-	-	-	-	-	-	シールド交換
	ENDURA Al PVD	⑫	6 inch	20年	4	4	4	4	-	4		
	ENDURA Ti PVD	①	6 inch	12年	4	4	4	4	4	4		
	ENDURA Ti PVD	⑥	8 inch	5年	-	-	-	-	-	-	-	シールド交換
	ENDURA TiN PVD	①	6 inch	12年	4	4	4	4	4	4		
	ENDURA TiN PVD	⑥	8 inch	5年	-	-	-	-	-	-	-	シールド交換
	ENDURA	⑫	6 inch	2年	2	3	2	-	-	-	-	手順書参考での作業
アルバック	CERAUS Z-1000	①	6 inch	13年	4	4	4	4	4	4		
	MCH-4500	①	6 inch	13年	4	4	4	4	4	4		
	蒸着装置	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	チャンバー洗浄業務全般	
東京エレクトロン	3180	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	シールド交換 ターゲット交換 チャンバー洗浄	
	3290	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	シールド交換 ターゲット交換 チャンバー洗浄	

イオン注入

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	電気系	機械駆動系	備考
住友精密工業	NV-GSD3 LE	⑫	5 inch	2年	2	3	2	-	-	-	手順書参考での作業
日新イオン機器	EXCEED 2000A	⑫	5 inch	2年	2	3	2	-	-	-	手順書参考での作業

WET

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	ヒーター系	薬液系	GAS系	制御系	機械駆動系	備考
エコー技研	アミン剥離	③	5 inch	12年	4	4	4	-	4	4	
ラムリサーチ	SEZ101	③	5 inch	12年	4	-	4	-	4	4	
	SEZ101	⑤	5 inch	2年	1	-	1	-	1	1	
	SEZ203	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	SEZ203	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	裏面ポリエッチ
	RST-101	⑦	6 inch	3年	2	2	2	-	2	2	裏面スピンエッチ
	RST-101	⑨	6 inch	3年	2	2	3	-	3	3	裏面スピンエッチ
	WBS001	⑧	6 inch	6ヶ月	2	-	-	-	2	2	裏面ポリエッチ
AMAT	MIRRA-3400	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	MIRRA-3400	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	CMP,CMW装置
ヒューゲルエレクトロニクス	CP2200	⑦	8 inch	1年	1	-	-	-	1	1	トラブル自体ほぼ無し
	CP2200	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	POD洗浄装置
セミツールジャパン	SST-8	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	SST-8	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	裏面外観チェッカー
	STORM-Ⅲ	⑦	8 inch	1年	1	2	-	-	1	2	トラブル自体ほぼ無し
	STORM-Ⅲ	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	STORM型POD洗浄装置
日東電工	NEL-DR8500-Ⅱ	⑦	8 inch	1年	1	-	-	-	1	1	トラブル自体ほぼ無し
	NEL-DR8500-Ⅱ	⑧	8 inch	2年	3	-	-	-	3	3	テープ貼付装置
	NEL-HR8500-Ⅱ	⑦	8 inch	1年	1	-	-	-	1	1	トラブル自体ほぼ無し
	NEL-HR8500-Ⅱ	⑧	8 inch	2年	3	-	-	-	3	3	テープ剥離装置
	TL-1	⑨	6 inch	2年	4	3	-	-	4	4	
エス・イー・テクノ	SET-200	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	ダミー再生装置
ダイフク	CLS-40	⑧	8 inch	2年	3	-	-	-	3	3	WET自動搬送システムラックマスター
	CTV-FX	⑧	8 inch	2年	3	-	-	-	3	3	WET自動搬送システムラックマスター
住友精密工業	KC-200A	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	キャリア洗浄装置
平田機工	KWO-T08	⑧	8 inch	2年	3	-	-	-	3	3	WET自動搬送システムポッドオープナー
コクサン	遠心乾燥器	⑨	6 inch	2年	4	-	-	-	4	3	
三益半導体	MSE-3000EL	⑨	6 inch	3年	4	4	4	-	4	4	裏面スピンエッチ
ダイトエレクトロン	CVP-310B	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	
	CVP-310B	⑨	6 inch	3年	4	-	-	-	3	3	端面研削
ニチデン機械	KPA洗浄	⑨	6 inch	2年	3	-	2	-	3	-	

WET

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	ヒーター系	薬液系	GAS系	制御系	機械駆動系	備考
SCREEN セミコンダクター (大日本スクリーン)	酸剥離 SPM・APM・HPM	③	5 inch	12年	4	4	4	-	4	4	
	AS-2000	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	AS-2000	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	CMP,CMW装置
	AS-2000	⑳	6 inch	3年	2	-	1	-	1	1	CMP後洗浄
	AS-2000	⑨	6 inch	3年	3	-	2	-	2	2	CMP後洗浄
	HF	㉑	6 inch	3年	2	2	3	-	3	3	酸化膜エッチ、スパッタ前処理リンガラス除去
	HF	⑨	6 inch	3年	3	3	4	-	4	4	酸化膜エッチ、スパッタ前処理リンガラス除去
	FL-820	㉑	6 inch	3年	3	2	2	-	3	3	ゲート酸化前処理
	FL-820	⑨	6 inch	3年	4	2	2	-	4	4	ゲート酸化前処理
	WAL-101	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	アルミスピンエッチ
	WAL-101	㉑	6 inch	3年	2	1	2	-	2	2	アルミスピンエッチ
	WAL-101	⑨	6 inch	3年	3	2	3	-	3	3	アルミスピンエッチ
	SPW-621	⑨	6 inch	2年	3	3	3	-	3	3	
	SR-2000A	⑦	8 inch	1年	1	1	1	-	1	1	
	SR-2000A	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	ポリマー除去装置
	SR-8040A	⑦	8 inch	1年	1	1	1	-	1	1	
	SR-8040A	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	ポリマー除去装置
	WS-820C	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	WS-820C	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	窒化膜エッチング装置
	WS-820L	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
WS-820L	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	余剰COエッチ、リンガラス除去、酸化膜エッチ、ブラッシング処理	
6DS-SP	㉑	6 inch	3年	2	2	2	-	2	2		
6DS-SP	⑨	6 inch	2年	3	3	3	-	3	3		
GLA001	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	リンガラス層除去装置	
WGO001,WGO002	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	ゲート酸化前処理	
DISCO	DFG-840	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	裏面研削装置
	DFG-840	⑤	5 inch	2年	1	-	1	-	1	1	ホイール交換
	DFG-841	⑤	5 inch	2年	1	-	1	-	1	1	ホイール交換
	DFG-841	⑦	8 inch	1年	1	-	-	-	1	1	トラブル自体ほぼ無し
	DFG-841	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	裏面研削装置
	DFG-84X	㉑	6 inch	3年	3	-	-	-	2	3	裏面研削

WET

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	ヒーター系	薬液系	GAS系	制御系	機械駆動系	備考
DISCO	DFG-84X	⑨	6 inch	3年	4	-	-	-	3	4	裏面研削
	DFG-8540	㉗	6 inch	3年	3	-	-	-	3	2	裏面研削
	DFG-8540	⑨	6 inch	3年	4	-	-	-	4	3	裏面研削
東邦化成 (カイジョー)	HH	⑨	6 inch	3年	4	4	4	-	4	4	酸剥離
	HH-200	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	PRA001	⑧	6 inch	6ヶ月	2	-	-	-	2	2	酸剥離装置
	PRA002	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	酸剥離装置
	PRH001	⑧	6 inch	6ヶ月	2	-	-	-	2	2	有機剥離装置
	HH-200	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸剥離装置
	RT-431T	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	RT-431T	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸化膜エッチ
	RT-432T	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	RT-432T	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸化膜エッチ
	RT-434T	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	RT-434T	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸化膜エッチ
	RT-563	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	RT-563	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸化膜エッチ
	RT-590	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	RT-590	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	余剰チタンエッチ
	RT-1031T	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	RT-1031T	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸剥離装置
	RT-1038T	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	RT-1038T	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸剥離装置
	WAC	㉗	6 inch	3年	3	3	3	-	3	3	酸洗浄
	WAC	⑨	6 inch	3年	4	4	4	-	4	4	酸洗浄
東邦化成 (カイジョー)	WAC-200	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	WAC-200	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	ノーマル酸洗浄装置、シリサイド酸洗浄装置
	WAC-201	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	WAC-201	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	酸洗浄装置
	WAP-101	㉗	6 inch	3年	3	3	3	-	3	3	有機剥離装置
	WAP-101	⑨	6 inch	3年	4	4	4	-	4	4	有機剥離装置

WET

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	ヒーター系	薬液系	GAS系	制御系	機械駆動系	備考
東邦化成 (カイジョー)	WSB001,002,003,004	⑧	6 inch	6ヶ月	2	-	-	-	2	2	酸洗浄装置
	WTI-200	⑦	8 inch	1年	2	2	2	-	2	2	
	WTI-200	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	余剰チタンエッチ
ローツエ	O3RS8258150	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	FABS装置
	O3RS8158020-W21	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	FABS装置
	6BRR8150-W20	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	FABS装置
	6BRR8020-W20	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	FABS装置
	9RRS8020-W21	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	FABS装置
	9RRS8150-W21-001	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	FABS装置
	9RRS8150-W21-002	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	FABS装置
ストラスパー	6DS-SP CMP	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	
	6DS-SP CMP	⑨	6 inch	3年	3	-	2	-	2	3	CMP
東横化学	OSS	⑧	8 inch	2年	3	-	3	-	3	3	薬液キャビネット装置
	FN-101	②⑦	6 inch	3年	3	2	3	-	2	2	裏面シリコンエッチ
	FN-101	⑨	6 inch	3年	4	3	4	-	3	3	裏面シリコンエッチ
	HF-10x	②⑦	6 inch	3年	2	2	2	-	2	2	拡散酸化膜エッチ、基板回復処理手動エッチ
	HF-10x	⑨	6 inch	3年	3	3	3	-	3	3	拡散酸化膜エッチ、基板回復処理手動エッチ
	PN-101	②⑦	6 inch	3年	3	2	3	-	2	2	窒化膜エッチ
	PN-101	⑨	6 inch	3年	4	3	4	-	3	3	窒化膜エッチ
	KPA洗浄	⑨	6 inch	2年	3	-	2	-	3	-	
	NIW001	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	窒化膜エッチング装置
	WED001	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	基板回復処理
	WBO001	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	拡散酸化膜エッチ
	RSW001	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	-	1	1	裏面シリコンエッチ
	薬液供給装置	⑨	6 inch	2年	2	-	3	-	3	-	
(不明)	レジスト剥離	③	5 inch	12年	4	4	4	-	4	4	

WET

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	装置レシビ	測定・検査	拡大適用	改善提案		備考
SCREEN セミコンダクター (大日本スクリーン)	HF-101	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		酸化膜エッチング装置
	HF-102	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		リンガラス層除去装置
	HF-103	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		スパッタ前処理装置
東横化学	WKT型HPM洗浄装置	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		
東邦化成 (カイジョー)	HH-101	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		酸剥離装置
	HH-102	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		酸剥離装置
	HH-103	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		酸剥離装置
	WAC-101	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		酸洗浄装置
	WAP-101	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		有機剥離装置
ノア・コーポレーション	HPM処理装置	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4		

拡散

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	ヒーター系	真空排気系	GAS系	制御系	機械駆動系	備考
東京エレクトロン	横型拡散炉 SD910	㊟	5 inch	12年	4	4	-	4	4	4	
	縦型拡散炉 IW6	㊟	5 inch	12年	4	4	-	4	4	4	
TEL	VCF-615S	㊟	6 inch	10ヶ月	4	3	-	3	3	-	縦型CVD装置
	VDF-615S	㊟	6 inch	1.5年	4	3	-	4	3	-	縦型拡散装置
AMAT	Vantage ATM	㊟	12 inch	1.5年	3	3	-	1	4	1	ランプアニール
	Vantage ISSG	㊟	12 inch	1.5年	3	3	3	1	4	1	ランプアニール
東横化学	DFS-2	㊟	6 inch	1.5年	4	4	-	4	3	-	横型拡散装置
	DFS-4	㊟	6 inch	1.5年	4	4	-	4	3	-	横型拡散装置
メーカー	型 式	担当者	inch	年数	装置レシビ	測定・検査	拡大適用	改善提案		備考	
TEL	縦型拡散炉	㊟	6 inch	3年	4	-	4	4			
	横型拡散炉(#10~70)	㊟	6 inch	3年	4	-	4	4			
	横型拡散炉(#80~)	㊟	6 inch	3年	4	-	4	4			

フォトリソグラフィー

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	WHメンテ	RHメンテ	WSメンテ	RSメンテ	ILPメンテ	メトロロジ	C&Tメンテ	改善提案	SW	備考
ASML	XT-1700Fi	⑩	12 inch	2年	4	3	3	3	2	2	3	-	2	
	XT-1900Gi	⑩	12 inch	2年	4	3	3	3	2	2	3	-	2	
	XT-1950Hi	⑩	12 inch	2年	4	3	3	3	2	2	2	-	2	
	NXT-1950Ai	⑩	12 inch	2年	4	3	3	3	2	2	3	-	3	
	NXT-1970Ci	⑩	12 inch	2年	4	3	3	3	2	2	3	-	3	
	XT-1700Fi	⑪	12 inch	10か月	3	3	2	2	2	2	3	-	2	
	XT-1900Gi	⑪	12 inch	10か月	3	3	2	2	2	2	3	-	2	
	XT-1950Hi	⑪	12 inch	10か月	3	3	2	2	2	2	3	-	2	
	NXT-1950Ai	⑪	12 inch	10か月	3	3	2	2	2	2	3	-	2	
	NXT-1970Ci	⑪	12 inch	10か月	3	3	2	2	2	2	3	-	2	
メーカー	型 式	担当者	inch	経験年数	基本操作	装置レシピ	条件評価	異常処置	改善提案		備考			
東京エレクトロン	MARK8	⑪	8 inch	2.5年	4	3	3	4	3		塗布/現像機			
	ACT8	⑪	8 inch	2.5年	4	3	3	4	3		塗布/現像機			
SCREENセミコンダクター (大日本スクリーン)	SS-80BW	⑪	8 inch	1年	3	2	2	4	2		両面スクラバー			
	SS-W80A	⑪	8 inch	1年	3	2	2	4	2		両面スクラバー			

DRY

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	電気系	機械駆動系	備考			
日立ハイテクノロジーズ	M-308	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1				
	M-602	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1				
ULVAC	NE7700	⑳	5 inch	5年	2	2	2	2	2	2				
	NE7700	㉕	5 inch	1.5年	-	3	-	-	-	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応			
	NE7700	㉔	5 inch	1.5年	-	3	-	-	-	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応			
東応化学	OAPM-301B	㉘	5 inch	15年	4	4	4	4	4	4				
	TUE-1102	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1				
	TUE-1102	⑩	6 inch	1年	4	4	-	4	3	-	Dryエッチング装置			
プラズマシステム	DES-212	㉘	5 inch	15年	4	4	4	4	4	4				
	DES-212	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1				
	DES-212	⑩	6 inch	1年	4	4	-	4	3	-	アッシング装置			
	DES-312	⑩	6 inch	1年	4	4	-	4	3	-	アッシング装置			

DRY

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	電気系	機械駆動系	備考	
AMAT	CENTURA AL DPS	①	8 inch	0.5年	1	1	-	1	-	1	エッチングチャンバー、アッシングチャンバー洗浄	
	CENTURA AL DPS	③	8 inch	0.5年	1	1	-	1	-	1	エッチングチャンバー、アッシングチャンバー洗浄	
	CENTURA AL DPS	⑳	8 inch	1年	1	1	-	1	-	1	エッチングチャンバー、アッシングチャンバー洗浄	
	CENTURA AL DPS	⑤	8inch	0.5年	1	1	-	1	-	1	エッチングチャンバー洗浄	
	CENTURA AL DPS	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1		
	Sym3	㉑	12 inch	3ヶ月	2	2	-	-	-	-	1	
	CENTURA	⑳	12 inch	4か月	2	3	-	-	-	-	2	
	CENTURA	㉑	12 inch	8ヶ月	2	3	-	-	-	-	1	
	P-5020	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1	1	
	P-5020	㉒	5 inch	15年	3	4	3	3	3	3	3	
	P-5020	⑤	5 inch	2年	1	2	1	1	1	1	1	チャンバー洗浄
	P-5030	㉒	5 inch	15年	3	4	3	3	3	3	3	
	P-5030	⑤	5 inch	2年	1	2	1	1	1	1	1	チャンバー洗浄
	PE-8300	⑤	5 inch	2年	2	1	2	1	1	1	1	チャンバー洗浄
	Vantage	⑫	12 inch	10ヶ月	1	1	1	-	-	-	-	
Centura	⑩	6 inch	10ヶ月	2	1	-	2	2	2	-	Dryエッチング装置	
キャノンアネルバ	ILD-4002	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	エッチングチャンバー洗浄	
	ILD-4002	㉒	5 inch	15年	4	4	4	4	4	4		
	ILD-4003	㉒	5 inch	15年	4	4	4	4	4	4		
	ILD-4003	㉓	5 inch	1.5年	-	3	-	-	-	-	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応
	ILD-4003	㉔	5 inch	1.5年	-	3	-	-	-	-	-	チャンバー清掃の定期メンテナンスのみ対応
	ILD-4003	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	1	エッチングチャンバー洗浄
	ILD-4032	㉒	5 inch	15年	4	4	4	4	4	4	4	
	ILD-4032	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	1	エッチングチャンバー洗浄
	ILD-4033	㉒	5 inch	15年	4	4	4	4	4	4	4	
	ILD-4033	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	1	エッチングチャンバー洗浄
	ILD-4015	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1	1	
	ILD-4015	⑩	6 inch	4ヶ月	2	-	-	3	2	-	-	Dryエッチング装置
	ILD-4017	⑩	6 inch	3ヶ月	1	-	-	1	1	-	-	Dryエッチング装置
	ILD-4033	⑩	6 inch	3ヶ月	2	-	-	2	2	-	-	Dryエッチング装置
ILD-4100	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1	1		

DRY

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	真空排気系	GAS系	制御系	電気系	機械駆動系	備考
キヤノンアネルバ	ILD-4100	⑩	6 inch	1.5年	1	2	-	3	1	-	Dryエッチング装置
	MAS801	⑳	5 inch	10年	2	4	2	2	2	2	
ラムリサーチ	R-4400	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1	
	R-4400	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	エッチングチャンバー洗浄
	R-4500	⑳	5 inch	10年	2	3	2	2	2	3	
	R-4500	⑤	5 inch	2年	1	1	1	1	1	1	エッチングチャンバー洗浄
	RAINBOW4401	⑩	6 inch	6ヶ月	2	-	-	2	2	-	Dryエッチング装置
	Kiyo	⑲	12 inch	1年	1	-	-	-	1	-	
	Exelan	⑳	8 inch	0.5年	-	2	-	-	-	-	エッチングチャンバー洗浄
	Exelan	⑲	12 inch	1年	1	-	-	-	1	-	
TEL	UNITY	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1	
	UNITY	⑳	8 inch	1年	-	2	-	-	-	-	エッチングチャンバー洗浄
	TE-5000	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1	
	TE-5000	⑩	6 inch	3ヶ月	2	-	-	2	2	-	Dryエッチング装置
	TE-8401	⑦	6 inch	6ヶ月	1	1	1	1	1	1	
TE-8401	⑩	6 inch	6ヶ月	3	2	-	3	2	-	Dryエッチング装置	

検査

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	搬送系	ヒーター系	薬液系	GAS系	制御系	機械駆動系	備考
KLA Tencor	OP-3290	⑦	8 inch	1年	3	-	-	-	3	3	
東京航空計器	5033A	⑧	8 inch	2.5年	3	-	-	-	3	3	裏面外観チェッカー
メーカー	型 式	担当者	inch	年数	基本操作	装置レシピ	条件評価	異常処置	改善提案		備考
日立テクノロジーズ	IS2610	⑬	8 inch	3年	4	-	-	2	2		暗視野自動外観検査装置(レーザー)
KLA Tencor	KLA2138	⑬	8 inch	3年	4	-	-	2	2		自動外観検査装置(ハゲソニア®)
	KLA2351	⑬	8 inch	3年	4	-	-	2	2		自動外観検査装置(ハゲソニア®)
LEICA	INS2000	⑬	8 inch	3年	4	3	3	2	-		光顕ビュー装置
JEOL	JWS9855	⑬	8 inch	3年	4	3	3	2	-		外観SEM/断面SEM/EDX
	JWS7555S	⑬	8 inch	3年	4	3	3	2	-		外観SEM

検査

メーカー	型 式	担当者	inch	経験年数	装置レシピ	測定・検査	拡大適用	改善提案		備考
SCREENセコニック (大日本スクリーン)	STM-603PS	㊟	6 inch	3年	-	2	-	-		ラムダエース膜厚測定器
トプコン	WM-2500	㊟	6 inch	3年	-	2	-	-		ゴミ検査装置
KLA Tencor	SURFSCAN-6420	㊟	6 inch	3年	-	2	-	-		ウェーハパーティクル検査装置
レオ技研	S-3304	㊟	6 inch	3年	-	2	-	-		ライフタイム測定器
ガートナー	L-115B	㊟	6 inch	3年	-	2	-	-		エリブソメーター
PROMETRIX	層抵抗測定器	㊟	6 inch	3年	-	1	-	-		オムニマップ
トムコ	DM150	㊟	6 inch	3年	4		-	4		IPAベーパー乾燥機
THERMA-WAVE	オプティプローブ	㊟	6 inch	3年	3	2	-	-		

搬送

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	基本操作	装置レシピ	条件評価	異常処置	改善提案		備考
平田機工	CVT-FX	㊟	8 inch	1年	1	-	-	-	1		
ローツエ	9RRS8150-W21-001	㊟	8 inch	1年	2	-	-	-	2		
	6BRR8150-W20	㊟	8 inch	1年	2	-	-	-	2		
	ソーター	㊟	12 inch	10年	4	-	-	-	-		装置オペレーションのみ
	03RS8258150	㊟	8 inch	1年	2	-	-	-	2		
シンフォニアテクノロジー (神鋼電機)	SELOM8C4PTF	㊟	8 inch	1年	3	-	-	-	3		
	SELOM8C4PTF-L3	㊟	8 inch	2年	3	-	-	-	3		POD, キャリア搬送機
ダイフク	CLS-40	㊟	8 inch	1年	1	-	-	-	1		
	ストッカー	㊟	6 inch	3年	3	-	-	3	3		
	ストッカー	㊟	6 inch	6ヶ月	1	-	-	1	1		
	ストッカー	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4	4		
	クリーンウェイ	㊟	6 inch	3年	3	-	-	3	2		フロア間搬送
	クリーンウェイ	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4	3		フロア間搬送
	CTV	㊟	6 inch	3年	3	-	-	3	2		フロア間搬送
	CTV	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4	3		フロア間搬送
三機	スカイライナー	㊟	6 inch	3年	3	-	-	3	3		スカイライナー、物流間搬送、高速縦搬送
	スカイライナー	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4	4		スカイライナー、物流間搬送、高速縦搬送
	スカイリフター	㊟	6 inch	3年	3	-	-	3	1		フロア間搬送
	スカイリフター	㊟	6 inch	3年	4	-	-	4	1		フロア間搬送

搬送

メーカー	型 式	担当者	inch	年数	基本操作	装置レシビ	条件評価	異常処置	改善提案		備考
タカトリ	ATM/ATRM/TEAM	⑧	6 inch	6ヶ月	1	-	-	1	1		テープ剥がし、テープ貼り付け
	ATM/ATRM/TEAM	⑨	6 inch	3年	4	-	-	4	4		テープ剥がし、テープ貼り付け
日東電工	TL/TR	⑨	6 inch	3年	4	-	-	4	3		テープ剥がし、テープ貼り付け
椿本	リフター	⑺	6 inch	3年	3	-	-	3	2		フロア間搬送
	リフター	⑨	6 inch	3年	4	-	-	4	2		フロア間搬送
(不明)	LTA-2	⑩	6 inch	1.5年	4	-	-	-	4		ウエハー立替機

(液晶)BMRGB

メーカー	型 式	担当者	年数	搬送系	ヒーター系	薬液系	GAS系	制御系	機械駆動系	備考
アルバック	SMD-2400	⑳	1年	3	2	3	3	2	3	液晶スパッタ装置立ち上げ・メンテナンス
	SMD-3000	㉑	1.5年	3	2	3	3	2	3	液晶スパッタ装置立ち上げ・メンテナンス
東京応化工業	TR165FCS	㉒	1.5年	2	-	-	2	1	3	液晶コーター装置立ち上げ
YASKAWA	MOTOMAN CDL3000	㉓	1年	3	-	-	-	2	3	コントローラーXRCタイプ

評価項目の説明

搬送系	ロボット、コンベア、エレベーターなどウエハーを搬送する機構の理解がある
真空排気系	真空ポンプ、筐体排気、リーク箇所、真空排気ラインの構造理解がある
GAS系	装置のGAS抜き、GAS出し、GASラインの構造について、危険性を理解し安全で適切な対応が可能
制御系	制御基板、信号基板、シーケンサー、ポンプコントローラー、冷却水など装置の制御理解がある
定期点検	各種操作方法を理解し、装置全体のMAN操作が出来、電源確認調整作業が可能
機械駆動系	モーター、ギア、シリンダー、空圧機器など駆動部機構の理解がある
電気系	センサー、スイッチ、パワーサプライ、電源ユニット、電気図面などの理解がある
ヒーター系	昇温方法、降温方法、ヒーター構造を理解し、安全で適切な対応が可能
薬液系	薬液抜き、薬液交換、薬液ラインの構造を理解し、液漏れなど安全で適切な対応が可能
基本操作	装置のオペレーションソフトウェアを理解し、製造処理するための操作を行う事が出来る
装置レシピ	装置の製造プロセスを理解し、製造処理を行う為のレシピの組み立て、修正を行う事が出来る
測定・検査	生産処理された製品を測定機にかけて検査することが出来る
条件評価	製造処理された製品の測定結果を基に、仕様に沿った条件が合致しているかを判断し、評価することが出来る
拡大適用	条件評価で得た結果を基に同型他機種にも展開することが出来る
異常処理	製品製造処理途中で何らかの異常が発生した時に、製品の回収、異常に対する初期行動を行う事が出来る
改善提案	装置の先天性の不具合に対して改善可能な条項を提案し、実行することが出来る
WHメンテ	Wafer Handlerの移載、pre-alignment、温調などの構造に理解がある
RHメンテ	Reticle Handlerの移載、pre-alignment、ゴミ検知などの構造、Reticle(Mask)に理解がある
WSメンテ	Wafer StageのAlignment方法、position制御（エンコーダ制御、IFM制御、GP制御など）、温調などの構造、各センサーに理解がある
RSメンテ	Reticle StageのAlignment方法、Position制御、各センサーの構造に理解がある
ILPメンテ	Illuminationの駆動部の構造、Laser Beamのデリバリー概念、Projection Lens、収差など光学的分野の理解がある
メトロロジー	Alignment Laserの構造や波長などの概念、Wafer面内及び各ダイのFocus、位置、Tiltなどのナノメートル単位の補正校正テスト、各センサーに理解がある
C&Tメンテ	装置全体の冷却水、循環水などの冷却関連水のライン、液浸水のラインの構造に理解がある 装置全体のクリーンエア、ガス（N2,CO2,Air）、Exhaustのラインの構造及び制御に理解がある 装置全体の温調関係の水ライン、ガスラインの図面、電機図面に理解がある
SW	装置内の通信、露光機とTrackとの通信、装置とFabネットワークとの通信に理解がある